

GTK-OSI1

被動光學元件檢測機

20_{pcs}
MT/MMC
批量檢測

3 σ ±0.1 μ m
重複檢測精度



產品介紹

精密光學元件檢測

超精密光學被動元件自動檢測機，針對FAU、FA、V-Groove、MT/MMC Ferrule等光學元件檢測需求設計，結合自動化量測與3 σ ±0.1 μ m 重複檢測精度，提升檢測結果的一致性與可靠性。

產品價值

實現光學元件高效量產

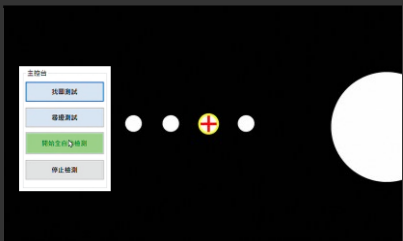
支援多種產品型態與通道數規格，並可進行MT/MMC Ferrule 批量檢測。透過一鍵自動檢測流程與單芯 1 秒內的檢測效率，協助降低操作門檻、提升量產檢測效率，並強化製程中的品質控管能力。

產品諮詢

產品規格

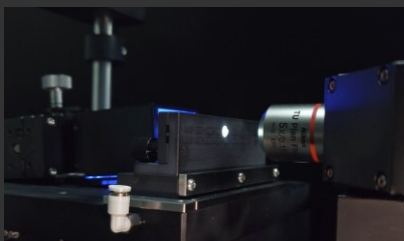
尺寸 (mm)	1940 (L) x 851 (W) x 1732 (H)	CCD	4508 x 4098 Pixels
重量	440 Kg	PC系統	Windows 11
適用元件	FAU, Fiber Array, V-Groove, MT/MMC	量測時間	1 – 2 sec/1 core, 1 groove
影像重複測量	FA, VG: 3 σ ±0.05 μ m MT, MMC: 3 σ ±0.1 μ m	自動化XYZ三軸位移	X-軸: 100mm, Y-軸 : 12mm, Z-軸: 40mm

關鍵技術



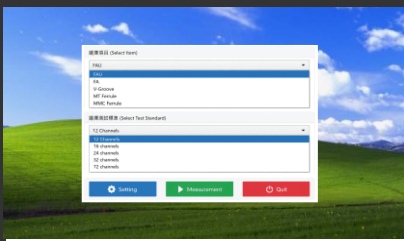
自動對焦與量測

從上料、定位、自動對焦到結果輸出的自動檢測流程，降低操作門檻與培訓成本。



批量檢測

單次最高可批量檢測20個MT, MMC光學元件，滿足量產全檢需求。



測試通道數介面選擇

程式支援多種光學被動元件及不同通道數選擇，最大檢測面積為100x8 mm。